(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平11-234009

(43)公開日 平成11年(1999)8月27日

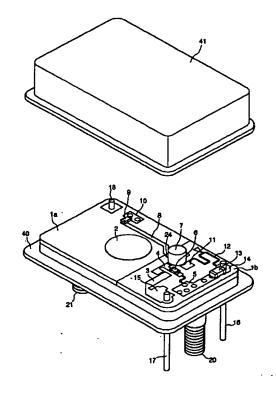
(51) Int. C1.6	識別記号		FI			
H 0 1 P	7/10		H01P	7/10		
	1/04			1/04		
	3/08			3/08		
H 0 3 B	5/18		H 0 3 B	5/18 D		
	審査請求 未請求 請求項の数4	OL		(全7頁)		
(21)出願番号	特願平10-32882		(71)出願人	000006231		
				株式会社村田製作所		
(22)出願日 平成10年(1998)2月16日			京都府長岡京市天神二丁目26番10号			
			(72)発明者 梶川 武久			
				京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式		
			(79)祭昭孝	会社村田製作所内 坂本 孝一		
			(12) 75 914	京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式		
				会社村田製作所内		
			(72)発明者	山下 貞夫		
			(12)	京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式		
	·		•	会社村田製作所内		
	•		(74)代理人	弁理士 小森 久夫		

(54) 【発明の名称】発振器装置

(57) 【要約】

【課題】 単体の誘電体共振器を用いることによる、誘 電体共振器とマイクロストリップ線路との結合度の再現 性の問題を解消するとともに、誘電体基板に誘電体共振 器部を構成する場合の、誘電体共振器部の大型化および 発振器部の寸法精度の問題を解消した発振器装置を提供 する。

【解決手段】 誘電体基板1a上に共振器用電極2を形 成して誘電体共振器部を構成するとともに、誘電体基板 1 b上にFET7を用いた発振器部を構成し、各構成部 が最適な状態となるように、誘電体基板1aと1bとの 誘電率を異ならせたり、厚みを異ならせる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 誘電体基板上に誘電体共振器部と発振器部とを設けて成る発振器装置において、

前記誘電体基板上に共振器用電極を形成して前記誘電体共振器部を構成するとともに、該誘電体共振器部を構成する領域と前記発振器部を構成する領域とで誘電体基板の誘電率を異ならせたことを特徴とする発振器装置。

【請求項2】 誘電体基板上に誘電体共振器部と発振器部とを設けて成る発振器装置において、

前記誘電体基板上に共振器用電極を形成して前記誘電体 10 共振器部を構成するとともに、該誘電体共振器部を構成 する領域と前記発振器部を構成する領域とで誘電体基板 の厚みを異ならせたことを特徴とする発振器装置。

【請求項3】 前記誘電体共振器部に結合する線路を該 誘電体共振器部を構成する領域に設け、前記線路の端部 における前記誘電体基板の誘電率または厚みが変化する 部分にインピーダンスマッチング回路を設けた請求項1 または2に記載の発振器装置。

【請求項4】 前記線路を主線路とし、この主線路とは別に前記誘電体共振器部に結合する副線路と、該副線路に接続される可変リアクタンス素子とを前記誘電体共振器部を構成する領域に設けたことを特徴とする請求項1~3のうちいずれかに記載の発振器装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、マイクロ波帯や ミリ波帯で使用される発振器に関する。

[0002]

【従来の技術】近年の移動体通信システムの需要の拡大 および伝送情報量の拡大に伴って、通信帯域がマイクロ 30 波帯からミリ波帯へ拡大されようとしている。このよう な高周波帯域において発振器を構成する場合、その共振 器として誘電体共振器が用いられている。

【0003】図7は従来の発振器の構成を示す分解斜視図である。同図において1は誘電体基板であり、その表面にマイクロストリップ線路8などの各種導電体パターンを形成し、FET7を実装することによって発振回路を構成し、さらに誘電体基板1の上面に支持台43を介して誘電体共振器42を配置させている。このような誘電体基板1をステム40に載置し、キャップ41を被せ40ることによって誘電体基板1の周囲全体をシールドしている。

【0004】図8は図7に示した誘電体共振器の共振モードによる磁界分布とマイクロストリップ線路との結合関係を示す図である。ここで誘電体共振器42はTE010モードで共振し、その磁界がマイクロストリップ線路8と結合する。このように、誘電体共振器42の磁界分布は図8に示すように周囲に広がっている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】このようなTE01∂ 50

モードの誘電体共振器を用いた従来の発振器において は、誘電体共振器の共振周波数が円柱形状の誘電体の比 誘電率と外形寸法によって決定され、またマイクロスト リップ線路との結合が、相互間の距離によって決定され るため、誘電体共振器42と支持台43に高い寸法精度 が要求され、さらに誘電体基板1上への誘電体共振器4 2の高い位置決め精度が要求される。また、マイクロス トリップ線路8と誘電体共振器42との結合を変化させ るために、誘電体共振器42の位置を変化させると、誘 電体共振器42の磁界分布は図8に示したように周囲に 広がっているため、誘電体共振器42はマイクロストリ ップ線路8以外の他の線路とも結合して結果的に発振条 件が変化する。そのために誘電体共振器42とマイクロ ストリップ線路8との結合を独立して変化させられな い。このことにより、誘電体共振器42とマイクロスト リップ線路8との位置関係による結合度の再現性が悪 く、安定した特性が得にくいという問題があった。ま た、TE018モードの誘電体共振器は誘電体部分への エネルギの閉じ込め性が比較的低いため、所定のマイク ロストリップ線路以外の線路との不要結合を防止するた

【0006】そこで誘電体基板の一部を誘電体共振器部として作用させることが考えられる。そのような発振器装置を設計する際、誘電体共振器部と発振器部とについて、それぞれ所定の特性が得られるように設計を行うことになる。

めに、誘電体共振器に結合させない線路と誘電体共振器

との間隔を大きく隔てなければならず、全体に小型化が

困難になるという問題もあった。

【0007】しかし、誘電体共振器部が最適な状態となるように設計する場合、小型でQoo良好な誘電体共振器を設計するために、誘電体基板としては、誘電率が高く且つ誘電正接($tan\delta$)が小さい誘電体材料を選ぶことになる。ところがこのとき基板の誘電率が高いために、発振器部のパターンは小さくなりすぎ、パターン間で不要な結合が生じたり、相対的な寸法精度が低下するため量産性が悪くなる。一方、発振器部が最適となるように設計する場合、誘電体共振器部が最適となるように設計する場合より低誘電率の誘電体基板を用いることになり、発振器部のパターン間での不要な結合を避け、相対寸法精度を高くすることができるが、その反面、誘電体共振器部が大きくなるといった問題が生じる。

【0008】この発明の目的は、従来の単体の誘電体共振器を用いることによる問題を解消するとともに、誘電体基板に誘電体共振器部を構成する場合の上述した問題を解消した発振器装置を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】この発明の発振器装置は、請求項1に記載のとおり、誘電体基板上に誘電体共振器部と発振器部とを設けて成る発振器装置において、 誘電体基板上に共振器用電極を形成して前記誘電体共振 器部を構成するとともに、該誘電体共振器部を構成する領域と前記発振器部を構成する領域とで誘電体基板の誘電率を異ならせる。この構成によれば、誘電体共振器部を構成する領域を誘電体共振器部に適する誘電率とし、発振器部を構成する領域を発振器部に適する誘電率にすることができ、小型でQoの高い誘電体共振器部を構成するとともに、パターン間の不要結合がなくパターンの相対寸法精度の高い、量産性の高い発振器部を構成することができる。

【0010】またこの発明の発振器装置は、請求項2に 10 記載のとおり、上記誘電体共振器部を構成する領域と発振器部を構成する領域とで誘電体基板の厚みを異ならせる。

【0011】これにより、例えば誘電体共振器部と発振器部の誘電率が同一であっても誘電体共振器部と発振器部の構成にそれぞれ適した誘電体基板とすることができる。一般には、誘電体共振器部を構成する領域の誘電体基板の厚みを、発振器部を構成する領域の誘電体基板の厚みより厚くすることにより、Qoの高い誘電体共振器部を構成する(表1参照)とともに、発振器部のパター 20ンを適度な大きさとすることができ、パターン間の不要結合の問題および相対寸法精度の低下の問題が避けられる。

【0012】またこの発明の発振器装置は、請求項3に記載のとおり、前記誘電体共振器部に結合する線路を該誘電体共振器部を構成する領域に設け、前記線路の端部における前記誘電体基板の誘電率または厚みが変化する部分にインピーダンスマッチング回路を設ける。これにより、線路同士の接続部の不連続性による不要な反射がなくなり、動作の安定した発振器が構成される。

【0013】また、この発明の発振器装置は、請求項4に記載のとおり、前記線路を主線路とし、この主線路とは別に前記誘電体共振器部に結合する副線路と、該副線路に接続される可変リアクタンス素子とを前記誘電体共振器部を構成する領域に設ける。この構成により、誘電体共振器部を構成する領域は周波数可変共振器部となる。

[0014]

【発明の実施の形態】この発明の第1の実施形態に係る 発振器の構成を図1~図3を参照して説明する。

【0015】図1は発振器の分解斜視図である。同図において40はステムであり、図における下方へピン16,17,18をそれぞれ絶縁状態で突出させている。また同方向に固定用のネジ20,21を突出させている。このステム40の上部には、各種の導電体パターンを形成するとともに部品を実装した誘電体基板1a,1bを載置している。またステム40の上部にキャップ41を被せることによって、誘電体基板1a,1bの周囲をシールドしている。

【0016】誘電体基板1a, 1bの図における下面に 50

は、ピン16,17,18が通る部分を避けてほぼ全面 にアース電極を形成している。この誘電体基板1aと1 bとは当接させて、または所定の間隙を隔てて対向させ て、ステム40の上部に載置している。

【0017】誘電体基板1aの上面において、2は円形の共振器用電極であり、この共振器用電極2と誘電体基板1a下面のアース電極との間がTM010モードの誘電体共振器として作用する。8はマイクロストリップ線路であり、上記誘電体共振器に対して容量結合する。10はアース電極であり、上記誘電体共振器と結合するマイクロストリップ線路8の他方の端部とアース電極10との間には終端抵抗としてのチップ抵抗9を接続している。

【0018】誘電体基板1bの上部において、7はFETであり、マイクロストリップ線路8の一方の端部に接続されるゲート端子接続電極24とマイクロストリップ線路4,11にそれぞれ接続している。5はアース電極であり、マイクロストリップ線路4との間にチップ抵抗6を接続している。マイクロストリップ線路4と3との間には誘電体基板1b上に静電容量を形成していて、マイクロストリップ線路3から延びる電極15を出力電極としてピン17に接続している。マイクロストリップ線路11と入力電極14との間はインダクタとしてのマイクロストリップ線路12で接続している。入力電極14とアース電極5との間にはチップコンデンサ13を接続している。

【0019】マイクロストリップ線路8の端部と、ゲート端子接続電極24との間はリボンまたはワイヤによるボンディング接続を行っている。

30 【0020】図2は上記誘電体基板1aに構成される誘電体共振器部の電界分布の例を示す断面図である。このように誘電体基板1aを挟んで、少なくとも一方の共振器用電極2を円形とすることによって、TM010モードの誘電体共振器として作用する。

【0021】図3は図1に示した発振器の等価回路図である。図中の番号は図1に示した各部の番号に対応している。図3に示すように、共振器用電極2による共振器と結合し、抵抗9により終端されたマイクロストリップ線路8がFET7のゲートに接続されている。電源入力電圧はチップコンデンサ13とインダクタ12によるフィルタを介してFET7のドレインに印加される。発振信号はコンデンサを介してFET7のソースから出力端子へ取り出される。このようにして帯域反射型発振回路を構成する。

【0022】ここで、各種誘電体基板を用いて、上記誘電体共振器部を、共振周波数15GHzのTM010モードの共振器とするための各部の寸法などの関係を示す。

[0023]

【表1】

		,		
基板	Dmm	Qo	λgmm	wm
PTFE $\epsilon r = 2.6 t = 0.8mm$ $\tan \delta = 1.0e = 0.3$	15. 2	586	13.4	2.25
樹脂基板 εr=3.5 t=0.8mm tanδ=3.0e-03	13. 1	270	11.8	1.85
アルミナ ε r = 10.0 t=0.8mm tan δ=1.5e-03	7. 73	453	7.32	0.83
セラミック基板 ε r = 24.0 t=0.8mm tan δ =4.3e-05	4.99	1337	4.84	0.37
セラミック基板 ε r = 30.0 t=0.8mm tan δ =1.0e-04	4.46	1242	4.36	0.31
セラミック基板 εr=30.0 t=1.2mm tanδ=1.0e-04	4.46	1755	4.06	0.79
セラミック基板 εr=30.0 t=1.6mm tanδ=1.0e-04	4.46	2210	3.90	1.50

【0024】上表において、t は誘電体基板の厚み、D は共振器用電極の直径、Qoは誘電体共振器部の無負荷 20 Q、λgはマイクロストリップ線路を形成したときのそのマイクロストリップ線路の管内波長(伝送路波長)、wはマイクロストリップ線路の特性インピーダンスを50 Ωにするための、そのマイクロストリップ線路の幅である。

【0025】誘電体共振器部を構成した上記誘電体基板 1 a は、それ単体で誘電体共振器部の共振周波数やマイクロストリップ線路との結合度を調整する。また、発振器部を構成した上記誘電体基板 1 b は、それ単体で発振器部の負荷特性等を調整する。これらの調整済の誘電体 30 基板 1 a, 1 b を図1に示したようにステム 4 0 に載置し、マイクロストリップ線路 8 とゲート端子接続電極との接続およびピン16, 17, 18 との接続を行う。勿論、両誘電体基板 1 a, 1 b をステム上に取り付けた状態で、誘電体共振器部の調整と発振器部の調整を個別に行って、その後にマイクロストリップ線路 8 とゲート端子接続電極とを接続してもよい。また、このマイクロストリップ線路 8 とゲート端子接続電極との接続を行った後に、各部の調整を行ってもよい。

【0026】次に、第2の実施形態に係る発振器装置の 40 構成を図4に示す。(A)はその部分斜視図である。

(キャップは図において省略している。) この例では誘電体基板1 a の厚み寸法を誘電体基板1 b の厚み寸法より大きくしている。そして、そのことによりマイクロストリップ線路8の端部とゲート端子接続電極24との接続部分に段差が生じることになる。このように誘電体基板の厚み寸法が異なる場合、一般にマイクロストリップ線路8の特性インピーダンスとゲート端子接続電極(マイクロストリップ線路)24の特性インピーダンスとが異なった値となるため、両者の接続部分にインピーダン50

スマッチング回路を構成する。

【0027】同図の(B)はそのインピーダンスマッチング回路を設けない場合の構成を示す部分平面図および等価回路図である。同図において25は誘電体基板1bに設けたゲート端子接続用マイクロストリップ線路であり、その線路のインピーダンスを21とする。また、マイクロストリップ線路8のインピーダンスを21とする。この両者の電極をボンディング用リボン23でボンディングし、このボンディング用リボンの持つリアクタンスを11とする。マイクロストリップ線路8および25のリボン接続点での浮遊容量をそれぞれC1a,C1bとする。一般にこの接続点でのC1a,C1bは小さく、これによる線路のミスマッチは小さく、これに比べてリボンのリアクタンスL1によるミスマッチが大きく支配的となる。

【0028】同図の(C)は上記インピーダンスマッチング回路部分の構成を示す部分平面図および等価回路図である。同図において24はマイクロストリップ線路25の端部に設けたインピーダンスマッチング用の電極である。また、26はマイクロストリップ線路8の端部に設けたインピーダンスマッチング用の電極である。マッチング用電極26,24の電極の容量をそれぞれC2a,C2bとする。このC2a,C2bの値を所定値とすることにより、容量C2a,C2bとリボンのリアクタンスL1によるπ型回路で所定の周波数でのインピーダンスマッチングを図っている。

【0029】次に第3の実施形態に係る発振器装置の構成を図5および図6を参照して説明する。

【0030】図5は発振器の主要部の構成を示す斜視図である。誘電体基板1aの上面において、31は共振器用電極2による共振器と結合するマイクロストリップ線路であり、その端部とアース電極33との間にバラクタ

ダイオード32を実装している。またマイクロストリッ プ線路31の端部から、インダクタとしてのマイクロス トリップ線路34を形成している。36は制御電極であ り、この制御電極36とマイクロストリップ線路34の 端部との間にチップ抵抗35を実装している。また制御 電極36とアース電極10との間にチップコンデンサ3 7を実装している。ピン18は制御電極36に接続して いる。また、共振器用電極2とマイクロストリップ線路 8. 31とは、直流的に連続する導電体パターンとして いる。この連続部分の幅と長さによって、誘電体共振器 10 部とマイクロストリップ線路との結合度を定めている。

【0031】図6は図5に示した発振器の等価回路図で ある。図6の発振器部の構成は図3に示したものと同様 である。図6においてマイクロストリップ線路8は主線 路、31は副線路として作用し、インダクタ34、抵抗 35およびコンデンサ37はRFフィルタとして作用 し、制御入力電圧によってバラクタダイオード32の静 電容量が変化し、これにより副線路31の装荷容量が変 20 化することになるため、それに応じてFET7による発 振周波数が変化する。

図5においてその他の部分の構成は図4に示したものと

【0032】図4および図5に示した例では、2枚の誘 電体基板を用いたが、誘電体共振器部を構成する領域の 厚みと発振器部を構成する領域の厚みが異なった単一の 誘電体基板を用いてもよい。

【0033】また、以上に述べた各実施形態では共振器 用電極2とマイクロストリップ線路8,31の導電体パ ターンを連続するパターンとして同時に形成するか、近 接させるようにしたが、マイクロストリップ線路8,3 30 る。 1と共振器用電極2との間をワイヤボンディングしても よい。

[0034]

同様である。

【発明の効果】請求項1~4に記載の発明によれば、誘 電体共振器部と発振器部とをそれぞれ最適に設計するこ とができる。また、誘電体共振器部と発振器部とをそれ ぞれ単体の状態で調整できるため、それぞれに個別の調 整が可能となり、所望の特性が容易に得られる。

【0035】また、特に請求項1に記載の発明によれ ば、誘電体共振器部を構成する領域を誘電体共振器部に 40 適する誘電率とし、発振器部を構成する領域を発振器部 に適する誘電率にすることができ、小型でQoの高い誘 電体共振器部を構成するとともに、パターン間の不要結 合がなくパターンの相対寸法精度の高い、量産性の高い 発振器部を構成することができる。

【0036】請求項2に記載の発明によれば、誘電体共 振器部と発振器部とで同一材料の誘電体基板を用いて も、誘電体共振器部と発振器部の構成にそれぞれ適した 誘電体基板とすることができ、小型でQoの高い誘電体 共振器部を構成するとともに、発振器部のパターンを適 50 20.21-ネジ

度な大きさとすることができ、パターン間の不要な結合 の問題および相対寸法精度の低下の問題が避けられる。

【0037】請求項3に記載の発明によれば、誘電体共 振器部とそれに結合する線路とが同じ領域(誘電体共振 器部を構成する領域)に設けられるため、誘電体共振器 部と線路との相対的位置関係を高精度に保つことがで き、両者間の結合度のばらつきを抑えることができる。 しかも線路の端部における誘電体基板の誘電率または厚 みが変化する部分でインピーダンスマッチングが採られ るため、不要な信号の反射がなくなり、動作の安定した 発振器が構成される。

【0038】請求項4に記載の発明によれば、誘電体共 振器に結合する副線路に接続される可変リアクタンス素 子に対する制御電圧によって、発振周波数が変化するた め、電圧により発振周波数を制御することが可能とな る。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施形態に係る発振器装置の構成を示す 分解斜視図である。

【図2】誘電体共振器部の電界分布の例を示す断面図で ある。

【図3】発振器装置の等価回路図である。

【図4】第2の実施形態に係る発振器装置の分解斜視図 およびインピーダンスマッチング回路部の構成を示す図 である。

【図5】第3の実施形態に係る発振器装置の分解斜視図 である。

【図6】同発振器装置の等価回路図である。

【図7】従来の発振器装置の構成を示す分解斜視図であ

【図8】同発振器装置で用いる誘電体共振器の磁界分布 の例を示す図である。

【符号の説明】

1 a, 1 b-誘電体基板

2-共振器用電極

3, 4-マイクロストリップ線路

5-アース電極

6ーチップ抵抗

7 - F E T

8-マイクロストリップ線路(主線路)

8 - インピーダンスマッチング用電極

9-チップ抵抗

10-アース電極

11,12-マイクロストリップ線路

13ーチップコンデンサ

14-入力電極

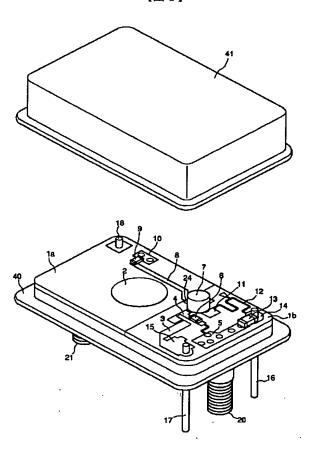
15-出力電極

16~18-ピン

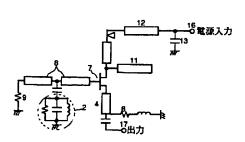
19-アース電極

- 22-ワイヤ
- 23-リボン
- 24-ゲート端子接続電極
 - 31-マイクロストリップ線路(副線路)
 - 32-バラクタダイオード
 - 33-アース電極
 - 34-マイクロストリップ線路(インダクタ)

【図1】

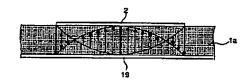


[図3]



- 35-チップ抵抗
- 36-制御電極
- 37-チップコンデンサ
- 40-ステム
- 41ーキャップ
- 42-誘電体共振器
- 43-支持台

【図2】



【図4】

